



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202021545 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120062612. 5

(22) 申请日 2011. 03. 10

(73) 专利权人 福建冠福现代家用股份有限公司  
地址 362500 福建省泉州市德化县浔中镇冠福产业园

(72) 发明人 曾昭泗

(74) 专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所  
有限公司 35204

代理人 李秀梅

(51) Int. Cl.

*B24B 39/06* (2006. 01)

*B24B 57/02* (2006. 01)

*B24B 55/04* (2006. 01)

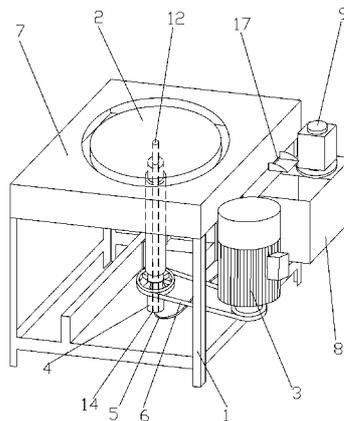
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

### (54) 实用新型名称

一种陶瓷制品抛光装置

### (57) 摘要

一种陶瓷制品抛光装置,包括机架、可转动地水平设置于机架上的磨盘、以及通过传动机构连接驱动磨盘转动的电机,所述传动机构具有与磨盘底部中心固定连接的垂直传动轴,还包括有供液装置,所述磨盘中心形成有上下贯通的出液口,所述垂直传动轴沿轴向贯通形成有与出液口对准连通的让位孔,所述供液装置的供液管道穿过所述让位孔与出液口连通。采用本实用新型进行陶瓷制品的抛光,大大减少了粉尘对工作环境造成的污染,减少了操作工的工作量,提高了工作效率。



1. 一种陶瓷制品抛光装置,包括机架、可转动地水平设置于机架上的磨盘、以及通过传动机构连接驱动磨盘转动的电机,所述传动机构具有与磨盘底部中心固定连接的垂直传动轴,其特征在于:还包括有供液装置,所述磨盘中心形成有上下贯通的出液口,所述垂直传动轴沿轴向贯通形成有与出液口对准连通的让位孔,所述供液装置的供液管道穿过所述让位孔与出液口连通。

2. 如权利要求 1 所述的一种陶瓷制品抛光装置,其特征在于:所述传动机构由传动轴、分别设置于传动轴与电机输出轴上的皮带轮、以及张紧于两皮带轮之间的皮带组成。

3. 如权利要求 1 所述的一种陶瓷制品抛光装置,其特征在于:所述机架上方还设有将所述磨盘包围于其中的防护罩,该防护罩顶部配合所述磨盘形状设有缺口。

4. 如权利要求 1 所述的一种陶瓷制品抛光装置,其特征在于:所述供液装置还包括有储液箱和将储液箱中的液体通过供液管道送至所述出液口的抽水泵,所述防护罩配合该储液箱还设有排液缺口。

5. 如权利要求 1 所述的一种陶瓷制品抛光装置,其特征在于:所述供液管道通过旋转接头与所述传动轴连接。

6. 如权利要求 1 所述的一种陶瓷制品抛光装置,其特征在于:所述磨盘表面设有金刚石层。

## 一种陶瓷制品抛光装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种陶瓷制品加工机械,特别是一种陶瓷制品抛光装置。

### 背景技术

[0002] 现有陶瓷制品抛光设备中,普遍采用固体模具进行抛光,如图 1 所示,包括有磨盘和驱动电机,使用时将待抛光陶瓷制品靠近磨盘表面进行抛光,采用这种抛光设备,抛光过程中产生大量粉尘,既污染环境,又增加了操作工的工作量,还会影响操作工的身体健康,降低工作效率。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于克服现有技术的上述缺点,提出一种陶瓷制品抛光装置。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种陶瓷制品抛光装置,包括机架、可转动地水平设置于机架上的磨盘、以及通过传动机构连接驱动磨盘转动的电机,所述传动机构具有与磨盘底部中心固定连接的垂直传动轴,还包括有供液装置,所述磨盘中心形成有上下贯通的出液口,所述垂直传动轴沿轴向贯通形成有与出液口对准连通的让位孔,所述供液装置的供液管道穿过所述让位孔与出液口连通。

[0006] 所述传动机构由传动轴、分别设置于传动轴与电机输出轴上的皮带轮、以及张紧于两皮带轮之间的皮带组成。

[0007] 所述机架上方还设有将所述磨盘包围于其中的防护罩,该防护罩顶部配合所述磨盘形状设有缺口。

[0008] 所述供液装置还包括有储液箱和将储液箱中的液体通过供液管道送至所述出液口的抽水泵,所述防护罩配合该储液箱还设有排液缺口。

[0009] 所述供液管道通过旋转接头与所述传动轴连接。

[0010] 所述磨盘表面设有金刚石层。

[0011] 由上述对本实用新型的描述可知,与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型的一种陶瓷制品抛光装置通过供液装置将液体送至磨盘出液口,同时磨盘的不停转动使得液体在离心力的作用下均匀分布于磨盘表面,因此,抛光过程中产生的粉尘能被液体全部带走并送至储液箱,液体可重复利用,操作工人只需清理储液箱即可,采用本实用新型进行陶瓷制品的抛光,大大减少了粉尘对工作环境造成的污染,减少了操作工的工作量,提高了工作效率。

### 附图说明

[0012] 图 1 为现有技术结构示意图;

[0013] 图 2 为本实用新型的立体结构示意图。

### 具体实施方式

[0014] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0015] 参照图 2、一种陶瓷制品抛光装置,包括机架 1、可转动地水平设置于机架 1 上的磨盘 2、以及通过传动机构连接驱动磨盘 2 转动的电机 3。磨盘 2 表面设有金刚石层能有效提高抛光效率。传动机构包括与磨盘 2 底部中心固定连接的垂直传动轴 4、分别设置于传动轴 4 与电机 3 输出轴上的皮带轮、以及张紧于两皮带轮之间的皮带 6 组成。机架 1 上方还设有将磨盘 2 包围于其中的防护罩 7,能有效防止液体四溅造成的对工作环境的不利于影响,该防护罩 7 顶部还设有配合磨盘 2 形状的缺口,工作人员可将待抛光陶瓷制品放置于缺口内的磨盘 2 上进行抛光。

[0016] 还包括有供液装置,磨盘 2 中心形成有上下贯通的出液口 12,垂直传动轴 4 沿轴向贯通形成有与出液口 12 对准连通的让位孔 14,供液装置的供液管道 5 穿过让位孔 14 与出液口 12 连通。供液装置还包括有储液箱 8 和将储液箱 8 中的液体通过供液管道 5 送至出液口 12 的抽水泵 9,防护罩 7 配合该储液箱 8 还设有排液缺口 17,用于将出液口 12 排出的液体回收至储液箱 8。供液管道 5 还可通过旋转接头(图中未标出)与传动轴 4 连接。

[0017] 上述仅为本实用新型的一个具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

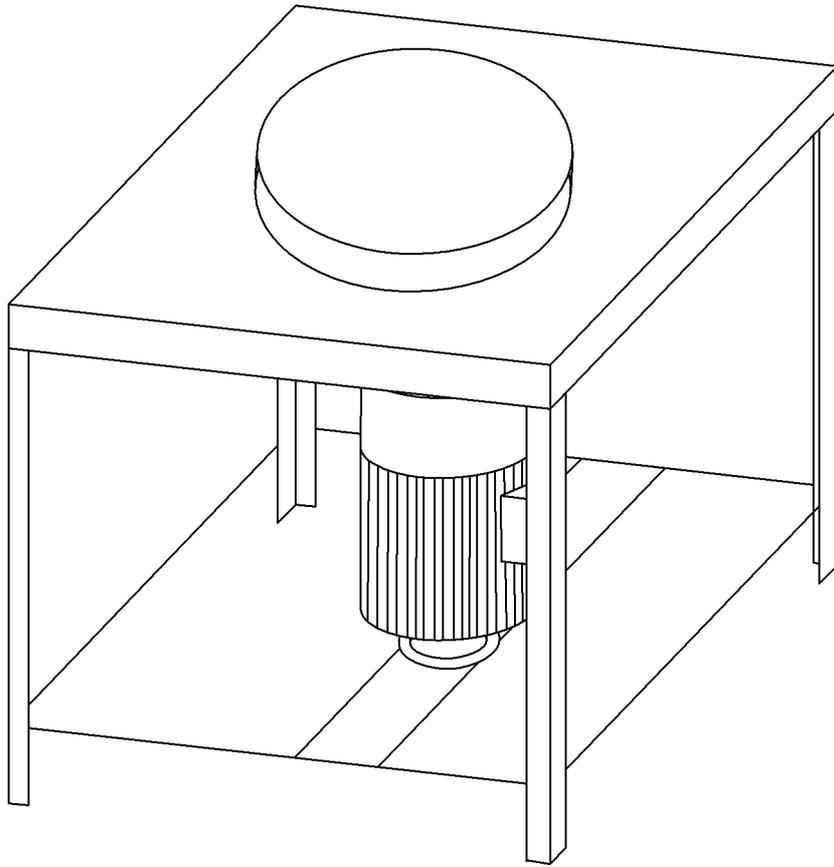


图 1

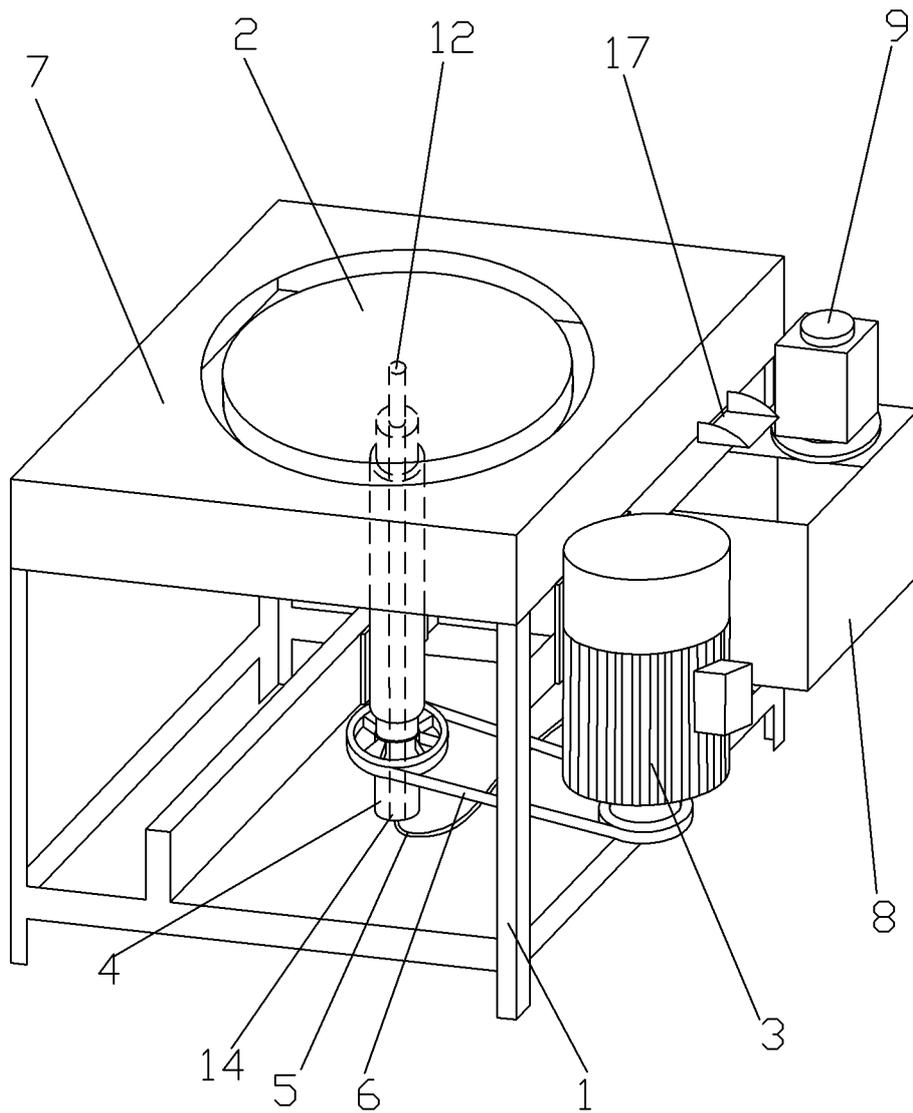


图 2